

# フィジカルセンサ研究会

〔委員長〕安達 洋（室蘭工大）  
〔幹事〕毛塚博史（東京工科大）

日時 9月20日（金） 13:30～17:00  
場所 姫路工業大学 書写記念会館（兵庫県姫路市書写2167，詳細は，  
URL:<http://www.himeji-tech.ac.jp/faculty/access.html>をご覧ください）  
共催 センシング技術応用研究会薄膜センサ技術分科会  
協賛 複合化センサとそのプロセス技術調査専門委員会（委員長 安達 洋，幹事 関村雅之，毛塚博史），次世代センサ協議会  
議題 テーマ「光応用プロセスと光応用デバイスおよびセンサー一般」

PHS-02-7 Hyper Omni Vision用CMOSカメラ  
大城 理，香川景一郎，太田 淳，菅 幹生（奈良先端大）  
土居元紀（大阪電気通信大），湊小太郎，布下正宏，千原國宏（奈良先端大）

PHS-02-8 蛍光・偏光・波長変調を用いた差分撮像  
山下 馨，木村貴之（大阪大），木村一貴（立命館大）  
奥山雅則（大阪大），濱川圭弘（立命館大）

PHS-02-9 光多重反射を用いたシリコン集積化ヘモグロビン量センサの諸特性  
高尾英邦，野田俊彦（豊橋技科大），宮村和宏（堀場製作所）  
足木光昭，澤田和明，石田 誠（豊橋技科大）

PHS-02-10 MEMS 技術を用いた光ジャイロに関する研究  
前田 耕平，上田 英喜，藤田 孝之，前中 一介，高山 洋一郎（姫路工大）

PHS-02-11 電子ビーム露光装置を用いた微小光学素子の作製  
四谷 任，余 万吉，豊田 宏（大阪科学技術センター）

PHS-02-12 マイクロ波プラズマCVDによる光ナノSi薄膜の作製とその評価  
毛塚博史（東京工科大），加藤 勇，斎藤良平（早稲田大），鈴木恒則（東海大）

PHS-02-13 AFMを用いたナノ加工・MEMS材料試験技術の開発  
生津資大（姫路工大），磯野吉正（立命館大）

PHS-02-14 金属コアを持つ圧電ファイバを用いたスマートボードの作製  
佐藤宏司，下條善朗，関谷 忠（産業技術総研）

PHS-02-15 ガイド波を用いた探傷用電磁超音波センサの開発  
問山清和，縄稚典生（広島県立西部工業技術センター）

\* 当日研究会終了後に懇親会を予定しております。研究会，懇親会の詳細，お問い合わせにつきましてはURL:<http://www4.eInics.eng.himeji-tech.ac.jp/k020920.html>をご覧ください。